

<i>Хайдаров З.Х.</i> Особенности автоэлектронной эмиссии в сверхтонком зазоре газоразрядной ячейки в полупроводниковой ионизационной камере	4
<i>Каримов Б.Х.</i> Фотовольтаический эффект в оптически активных кристаллах	8
<i>Погребняк А.Д., Свириденко Н.В., Курода С., Тюрин Ю.Н., Ердьбаева Н.К., Кульменева О.П.</i> Структура и свойства покрытий из титана нанесенного высокоскоростной детонационной струей на подложку из стали 3	13
<i>Широков Б.М., Корж А.Ф.</i> Физико-аналитическая модель нагрева газа в проточном термохимическом реакторе I	18
<i>Широков Б.М., Корж А.Ф.</i> Физико-аналитическая модель нагрева газа в проточном термохимическом реакторе II	23
<i>Пятак Н.И.</i> Расчет собственных частот связанных крестообразных волноводных разветвлений	28
<i>Погребняк А.Д., Ильяшенко М.В., Братушка С.Н., Понарядов В.В., Ердьбаева Н.К.</i> Формирование высокодисперсного состояния в плазменно-детонационном покрытии из оксида алюминия	32
<i>Погребняк А.Д., Ильяшенко М.В., Братушка С.Н., Понарядов В.В., Ердьбаева Н.К.</i> Физико-механические свойства керамических и металлокерамических покрытий, нанесенных плазменно-детонационным способом	48
<i>Антоненко А.Л.</i> Исследование влияния параметров потока плазмы на свойства формируемых покрытий	73
<i>Шамирзаев С.Х., Юсупова Д.А., Мухамедиев Э.Д., Онаркулов К.Э.</i> Определение эффективной плотности электронных поверхностных состояний в нанокристаллических пленках $Bi_2Te_3-Sb_2Te_3$	86
<i>Шамирзаев С.Х., Онаркулов К.Э., Юсупова Д.А., Мухамедиев Э.Д.</i> Простые модели усталостной повреждаемости гетерогенных материалов с очень сложной динамикой	91
<i>Возный А.В., Ям Дж.Ю., Кропотов А.Ю., Фареник В.И.</i> Формирование пучка нейтральных атомов для сухого травления и исследование его характеристик	97
<i>Береснев В.М., Толок В.Т., Швец О.М., Фурсова Е.В., Чернышов Н.Н., Маликов Л.В.</i> Микро-нанослойные покрытия, сформированные методом вакуумно-дугового осаждения с использованием ВЧ-разряда ..	104
<i>Сагалович А.В., Бабенко В.А., Дудник С.Ф., Богуславский Г.И., Петров В.Н., Сагалович В.В.</i> Исследование поведения многокомпонентных покрытий в агрессивных средах в процессе варки оптических стекол	110
<i>Дудин С.В.</i> Плазменное травление гетероструктур на основе нитрида галлия при изготовлении оптоэлектронных устройств	117
<i>Інформація</i> Інститут високих технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна	124
<i>Інформація</i> Міжнародна наукова конференція «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур»	127
<i>Інформація</i> Международная научная конференция «Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур»	128
<i>Information</i> International Conference “Physical and Chemical Principles of Formation and Modification of Micro- and Nanostructures”	129
<i>Правила оформлення статей</i>	130
<i>Правила оформления статей</i>	131
<i>Information for authors</i>	132